

課題番号 : F-13-FA-0001  
利用形態 : 機器利用  
利用課題名 (日本語) : 光エネルギー変換デバイスの開発  
Program Title (English) : Development Opto electronic devices  
利用者名 (日本語) : 久保 敏  
Username (English) : S.KUBO  
所属名 (日本語) : (有)FTC コーポレーション  
Affiliation (English) : FTC CORPORATION.

## 1. 概要 (Summary)

サファイア、ガラス、Si 基板上に高効率素子の製作  
耐候膜の開発製造  
高効率基板の開発、製造

## 2. 実験 (Experimental)

薄膜形成  
PE-CVD、LP-CVD、酸化炉  
パターン形成  
コータデベロッパ、露光機、RIE 他



Plasma CVD      Low Pressure CVD



Thermal Furnace      Reactive Ion Etcher

## 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

様々な形状作成し効率評価実施。  
膜については光の透過率、エネルギーロス低減に向けたサンプル製作評価中。

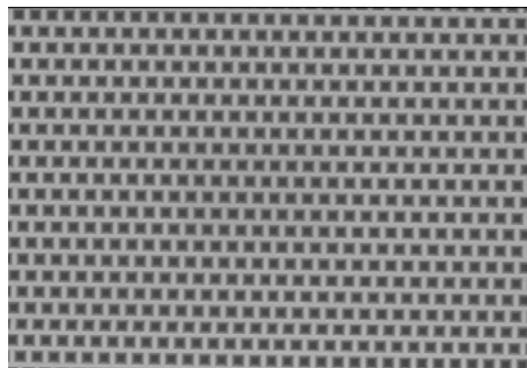
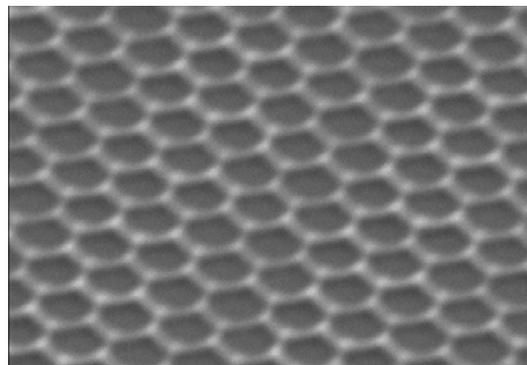


Fig1. High-efficient-Substrate

## 4. その他・特記事項 (Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許 (Patent)

なし。